(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 13. Juni 2002 (13.06.2002)

(72) Erfinder: und

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/47183 A1

[DE/DE]: Adalbert-Stifter-Str. 11, 91083 Baiersdorf (DE). CLEMENS, Wolfgang [DE/DE]; Kornstr. 5, 90617

Puschendorf (DE). HARING, Peter [DE/DE]: Bahnhofstr. 162. 52146 Würselen (DE). KURZ, Heinrich (AT/DE):

II. Rote Haag Weg 1 b. 52076 Aachen (DE). VRATZOV.

Borislav [BG/DE]; Wirichsbongardstr. 24, 52062 Aachen

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BERNDS, Adolf

(51) Internationale Patentklassifikation7: B29C 37/00

H01L 51/40.

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE01/04611

(22) Internationales Anmeldedatum:

7. Dezember 2001 (07.12.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT: Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(30) Angaben zur Priorität:

100 61 297.0

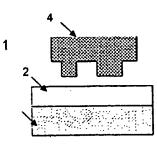
8. Dezember 2000 (08.12.2000)

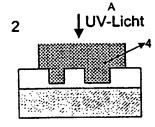
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP. US.
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelshacherplatz 2, 80333 München (DE).
- Bestimmungsstaaten tregionalt: europäisches Patent (AT. BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL. PT. SE. TR).

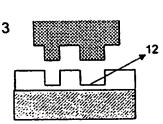
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

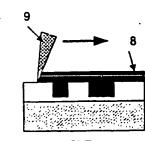
(54) Title: ORGANIC FIELD-EFFECT TRANSISTOR. METHOD FOR STRUCTURING AN OFET AND INTEGRATED CIR-CUIT

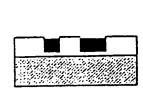
(54) Bezeichnung: ORGANISCHER FELD-EFFEKT-TRANSISTOR, VERFAHREN ZUR STUKTURIERUNG EINES OFETS UND INTEGRIERTE SCHALTUNG











5

A...UV LIGHT

(57) Abstract: The invention relates to an organic field-effect transistor, to a method for structuring an OFET and to an integrated discount with improved structuring of the functional polymer layers. The improved structuring is obtained by introducing, using a circuit with improved structuring of the functional polymer layers. The improved structuring is obtained by introducing, using a doctor blade, the functional polymer in the mold layer in which recesses are initially produced by imprinting.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

PCT/DE01/04611 WO 02/47183

Beschreibung

Organischer Feld-Effekt-Transistor, Verfahren zur Strukturierung eines OFETs und integrierte Schaltung

5

Die Erfindung betrifft einen Organischen Feld-Effekt-Transistor, ein Verfahren zur Strukturierung eines OFETs und eine integrierte Schaltung mit verbesserter Strukturierung der Funktionspolymerschichten.

10

25

Organische integrierte Schaltkreise (integrated plastic circuits) auf der Basis von OFETs werden für mikroelektronische Massenanwendungen und Wegwerf-Produkte wie Identifikationsund Produkt-"tags" gebraucht. Ein "tag" ist z.B. ein elektro-15 nischer Streifencode, wie er auf Waren angebracht wird oder auf Koffern. OFETs haben ein weites Einsatzgebiet als RFIDtags: radio frequency identification - tags, die nicht nur auf der Oberfläche angeordnet sein müssen. Bei OFETs für diese Anwendungen kann auf das excellente Betriebsverhalten der Silizium-Technologie verzichtet werden, aber dafür sollten niedrige Herstellungskosten und mechanische Flexibilität gewährleistet sein. Die Bauteile wie z.B. elektronische Strich-Kodierungen, sind typischerweise Einwegeprodukte und sind wirtschaftlich nur interessant, wenn sie in preiswerten Prozessen hergestellt werden.

Bisher wird, wegen der Herstellungskosten, nur die Leiterschicht des OFETs strukturiert. Die Strukturierung kann nur über einen zweistufigen Prozess ("Lithographiemethode" vgl. dazu Applied Physics Letters 73(1),1998, S.108.110 und Mol.Cryst.Liq. Cryst. 189,1990, S.221-225) mit zunächst vollflächiger Beschichtung und darauffolgender Strukturierung, die zudem materialspezifisch ist, bewerkstelligt werden. Mit "Materialspezifität" ist gemeint, dass der beschriebene Prozess mit den genannten photochemischen Komponenten einzig an dem leitfähigen organischen Material Polyanilin funktioniert. Ein anderes leitfähiges organisches Material, z.B. PolypyrWO 02/47183 PCT/DE01/04611

Rakeln von zumindest einem Funktionspolymer in eine Negativ-Form. Schließlich ist Gegenstand der Erfindung eine integrierte Schaltung, die zumindest einen OFET, der zumindest eine strukturierte Leiterschicht und eine weitere strukturierte Schicht hat, umfasst.

- Als Negativ-Form wird eine strukturierte Schicht oder ein Teil einer strukturierten Schicht bezeichnet, die Vertiefungen enthält, in die das Funktionspolymer, das z.B. eine 10 Elektrode eines OFETs oder eine Halbleiter- oder eine Isolatorschicht bildet, durch Rakeln eingefüllt wird.

Das Verfahren umfasst folgende Arbeitsschritte:

25

- a) auf einem Substrat oder einer unteren Schicht wird eine,
 ggf. vollflächige Formschicht, die nicht auf den Bereich,
 der strukturiert werden soll beschränkt sein muss, aufgebracht. Diese Formschicht ist nicht das Funktionspolymer
 (also halbleitende, leitende oder isolierende Schicht),
 sondern ein anderes organisches Material, das als Form
 oder Klischee für die leitende organische Elektrodenschicht dient. Dieses andere organische Material sollte
 isolierende Eigenschaften haben.
 - b) die Formschicht erhält durch Imprinting (Eindrücken eines Stempelabdrucks mit nachfolgender Aushärtung durch Belichten) Vertiefungen, die den Strukturen entsprechen,
 - c) in diese Vertiefungen wird dann das Funktionspolymer flüssig, als Lösung und/oder als Schmelze hineingerakelt.

Die Negativ-Form der Struktur auf der Formschicht kann durch
die Imprintmethode, die eine auf dem Gebiet der elektronischen und mikroelektronischen Bauteile ausgereifte Technik
darstellt, auf dem Substrat oder einer unteren Schicht erzeugt werden. Das Material der Negativ-Form kann ein UVhärtender Lack sein, der nach Imprinting und Belichten Vertiefungen besitzt.

PCT/DE01/04611 WO 02/47183

In der Regel kann man die Funktionspolymere weitgehend in ihrer optimalen Konsistenz belassen. So besitzt z.B. Polyanilin als leitfähiges organisches Material bei optimaler Leitfähigkeit eine bestimmte Viskosität. Wenn Polyanilin beispielsweise gedruckt werden soll und nicht eingerakelt, so muss seine Viskosität auf einen der Druckmethode angepassten Wert eingestellt werden. Das bedeutet meistens Einbusse der Leitfähigkeit. Für das Rakeln ist die Viskositätsspanne ungleich größer als für das Drucken, so dass in aller Regel keine Viskositätsänderungen am organischen Material vorgenommen werden müssen.

Schließlich ist ein Vorteil der Rakelmethode die Fähigkeit zu dicken Schichten. So ist z.B. die Leitfähigkeit von 1 μm dicken Polymerelektroden effektiv höher als bei üblicherweise $0.2 \mu m$ Schichtdicke. Ein OFET mit einer Schichtdicke im Bereich von bis zu 1µm, insbesondere im Bereich von 0,3 bis 0,7 µm ist deshalb vorteilhaft.

15

30

Als "Funktionspolymer" wird hier jedes organische, metallor-20 ganische und/oder anorganische Material bezeichnet, das funktionell am Aufbau eines OFET und/oder einer integrierten Schaltung aus mehreren OFETs beteiligt ist. Dazu zählen beispielhaft die leitende Komponente (z.B. Polyanilin), das eine 25 Elektrode bildet, die halbleitende Komponente, die die Schicht zwischen den Elektroden bildet und die isolierende Komponente. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung "Funktionspolymer" demnach auch nicht polymere Komponenten, wie z.B. oligomere Verbindungen, umfasst.

Als "organisch" wird hier kurz alles, was "auf organischem Material basiert "bezeichnet, wobei der Begriff "organisches Material" alle Arten von organischen, metallorganischen und/oder anorganischen Kunststoffen, die im Englischen z.B. 35 mit "plastics" bezeichnet werden, umfasst. Es handelt sich um alle Arten von Stoffen mit Ausnahme der klassischen Halbleiter (Germanium, Silizium) und der typischen metallischen LeiWO 02/47183 PCT/DE01/04611

fertigen OFET das Funktionspolymer 8 die Vertiefungen 12 der Formschicht 2 ausfüllt.

Figur 2 zeigt eine weitere Ausführungsform des Verfahrens im 5 m kontinuierlichen Prozess oder kontinuierlichen Rollendruck. Zu sehen ist das Band aus Substrat oder unterer Schicht 1 mit dem Formpolymer 2, das ein UV-härtbarer, aber auch ein ther-... misch härtbarer Lack sein kann. Dieses Band wird nun von links nach rechts, wie durch den Pfeil 13 angedeutet, entlang 10 mehrerer Andruckrollen 10 verschiedenen Arbeitsschritten unterworfen. Zunächst passiert es das Schattenblech 3, mit dem das noch nicht gehärtete Formpolymer 2 gegen Bestrahlung geschützt wird. Danach werden in das Formpolymer 2 mit Hilfe der Stempelrolle 4 Vertiefungen eingeprägt, die mit der in 15 der Stempelrolle 4 integrierten UV-Lampe 5 gleich angehärtet werden. Die von 5 ausgehende Pfeilrichtung zeigt die Richtung des Lichtkegels, der von 5 ausgestrahlt wird, an. Das mit Vertiefungen 12 in der Formschicht 2 versehene Band zieht dann unter einer UV-Lampe oder Heizung 6 zur Nachhärtung vor-20 bei, so dass ein strukturierter Lack 7 entsteht. In den strukturierten Lack 7 mit den Vertiefungen 12 wird dann mit dem Rakel 9 das Funktionspolymer 8 eingerakelt, so dass die . fertige Struktur 11 entsteht.

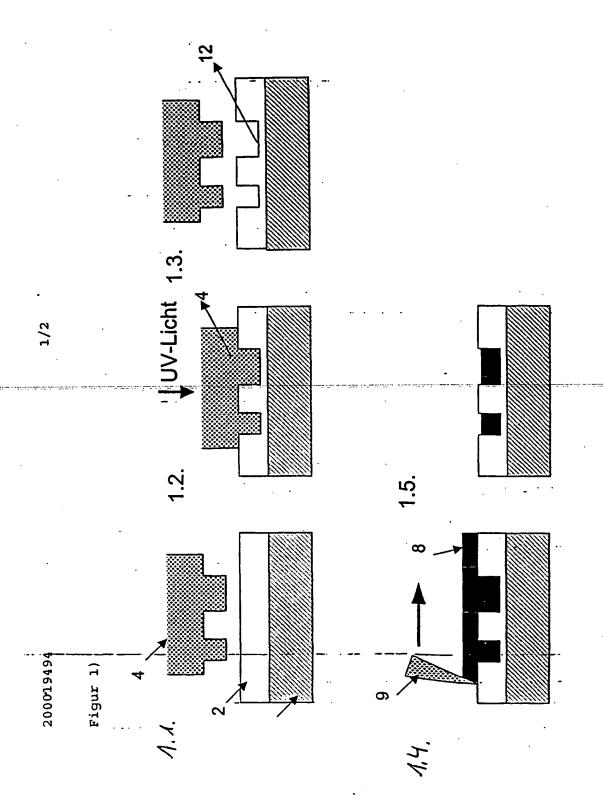
WO 02/47183 PCT/DE01/04611

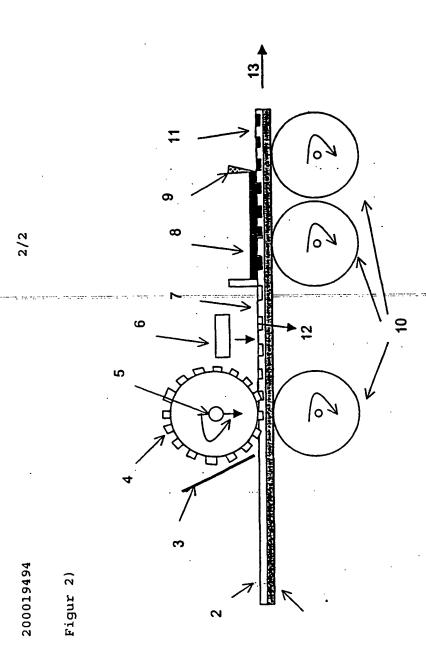
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 oder 6, bei dem die Formschicht nach der Strukturierung entfernt wird.

- 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, bei dem zumin-5 dest zweimal das Funktionspolymer in die Vertiefungen der Formschicht eingerakelt wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, bei dem die Vertiefungen in der Formschicht durch Imprinting erzeugt wer-10 den.
 - 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 9, das als kontiniuerliches Verfahren mit einem durchlaufenden Band durchgeführt wird.

15

...





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In all ational Application No PCT/DE 01/04611

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
1PC 7 H01L51/40 B29C37/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H01L B29C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ, WPI Data

	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Relevant to claim No.
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	770072410 02217770
X	DE 198 51 703 A (INST HALBLEITERPHYSIK GMBH) 4 May 2000 (2000-05-04)	1,4
Y	column 1, line 31 - line 63; figure 3	2,3,5-10
Y	EP 0 962 984 A (LUCENT TECHNOLOGIES INC) 8 December 1999 (1999-12-08) the whole document	2,3,5-10
Y	ROGERS J A ET AL: "PRINTING PROCESS SUITABLE FOR REEL-TO-REEL PRODUCTION OF HIGH-PERFORMANCE ORGANIC TRANSISTORS AND CIRCUITS"	2,3,5-10
	ADVANCED MATERIALS; VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 11, no. 9, 5 July 1999 (1999-07-05), pages 741-745, XP000851834 ISSN: 0935-9648	
	page 741, column 1, line 8 - line 31	

X Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
*Special categories of cited documents: *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international fixing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cred to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document reterring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filling date but taler than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention when the considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents; such combination being obvious to a person skilled in the art. *a" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
12 April 2002	23/04/2002
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tet (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax. (+31-70) 340-3016	Pusch, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

httpational Application No PCT/DE 01/04611

Patent document cited in search report		date	member(s)		date
DE 19851703	A	04-05-2000	DE	19851703 A1	04-05-2000
EP 0962984	Α	08-12-1999	EP JP	0962984 A2 2000029403 A	08-12-1999 28-01-2000
			US	410478 B 6150668 A	01-11-2000 21-11-2000
WO 0219443	A	07-03-2002	DE WO	10043204 A1 0219443 A1	04-04-2002 07-03-2002
WO 0079617	A	28-12-2000	AU	5549600 A	09-01-2001
•			EP WO	1192676 A1 0079617 A1	03-04-2002 28-12-2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

purunales Altienzeichen PCT/DE 01/04611

	KLASSIFIZIERUNG DES		
		29C37/	
I			

Nach der Internationalen Patentidassification (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfsloff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ, WPI Data

Categories	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
x	DE 198 51 703 A (INST HALBLEITERPHYSIK GMBH) 4. Mai 2000 (2000-05-04)	1,4
Y	Spalte 1, Zeile 31 - Zeile 63; Abbildung 3	2,3,5-10
Y	EP 0 962 984 A (LUCENT TECHNOLOGIES INC) 8. Dezember 1999 (1999-12-08) das ganze Dokument	2,3,5-10
Y	ROGERS J A ET AL: "PRINTING PROCESS SUITABLE FOR REEL-TO-REEL PRODUCTION OF HIGH-PERFORMANCE ORGANIC TRANSISTORS AND CIRCUITS"	2,3,5-10
-,,		
	Seite 741, Spalte 1, Zeile 8 - Zeile 31	

Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum		
A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam enzusehen ist	oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden		
"E" ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erlindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden		
L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft er- scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer			
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichtung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegaben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichtung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Aussteltung oder andere Maßnahmen bezieht			
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts		
12. April 2002	23/04/2002		
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigler Bediensteter		
NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3018	Pusch, C		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffertungen, un au annen unternation genomm

transitionales Aktenzeichen
PCT/DE 01/04611

im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamille		Datum der Veröffentlichung
DE 19851703	A	04-05-2000	DE	19851703 A1	04-05-2000
EP 0962984	A	08-12-1999	EP JP TW US	0962984 A2 2000029403 A 410478 B 6150668 A	08-12-1999 28-01-2000 01-11-2000 21-11-2000
WO 0219443	A	07-03-2002	MO	10043204 A1 0219443 A1	04-04-2002 07-03-2002
WO 0079617	A	28-12-2000	AU EP WO	5549600 A 1192676 A1 0079617 A1	09-01-2001 03-04-2002 28-12-2000

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.